智慧財產法院行政判決

108年度行專訴字第63號

原　　告　家登精密工業股份有限公司
代　表　人　邱銘乾
訴訟代理人　陳世杰　律師
　　余明賢　律師
　　許譽鐘　律師
被　　告　經濟部智慧財產局
代　表　人　洪淑敏
訴訟代理人　莊榮昌
參　加　人　美國安堤格里斯公司(ENTEGRIS,INC.)
代　表　人　Arlene Hornilla
訴訟代理人　張哲倫　律師　兼送達代收人
　　陳初梅　律師
　　陳佳菁　律師
複代理人　　吳俐瑩　律師

上列當事人間因發明專利舉發事件，原告不服經濟部中華民國108年7月3日經訴字第10806307430號訴願決定，提起行政訴訟，並經本院裁定命參加人獨立參加被告之訴訟，本院判決如下：

主　　文

原告之訴駁回。

訴訟費用由原告負擔。

事實與理由

壹、事實概要：

參加人先於民國92年7月3日以「標線載具」，嗣後更名為「光罩載具及支撐光罩之方法」，向被告申請發明專利，並以

西元2002年7月5日申請之美國第10/190,347號專利案主張優先權。經被告編為第00000000號審查，而於98年8月21日准予專利（下稱系爭專利），申請專利範圍共20項，並發給發明第I317967號專利證書。原告於107年5月4日以系爭專利請求項1、3、4、6、7、9、10、12、13及17有違核准時專利法第22條第1項第1款及第4項之規定，對之提起舉發(N04)。被告嗣以參加人在另案舉發(N03)案提出之107年6月13日說明書及申請專利範圍更正本，業經被告於108年1月16日9(108)智專三　04024字第10820049060號專利舉發審定書，審定「107年6月13日之更正事項，准予更正」，本件舉發(N04)案依更正本進行審查，並核認系爭專利請求項1、3、4、6、7、9、10、12、13及17未違反前揭專利法規定，以108年1月23日(108)智專三　04024字第10820075670號專利舉發審定書，作成「請求項1、3至4、6至7、9至10、12至13、17舉發不成立」處分。原告不服處分，提起訴願，經濟部嗣以108年7月3日經訴字第10806307430號訴願決定駁回，原告不服訴願，遂向本院提起行政訴訟。因本院認本件判決之結果，倘認訴願決定應予撤銷，將影響參加人之權利或法律上之利益，爰命參加人獨立參加本件被告之訴訟（見本院卷一第159至166頁）。

貳、原告聲明原處分與訴願決定均撤銷，暨被告應就系爭專利為請求項1、3、4、6、7、9、10、12、13、17舉發成立應予撤銷之處分，並主張如後：

一、系爭專利全部特徵遭證據2揭露而不具新穎性與進步性：

(一)證據2揭露支承光罩技術與初步定位光罩特徵：

依被告專利舉發審定書與經濟部訴願決定書記載可知，參加

人未否認證據2揭露對應系爭專利「光罩支架」、「可在其上橫向滑動」技術特徵。準此，依證據2整體結構配置可知，「基部：下蓋(2)」設置「光罩支架：銷(8)」用以放置光罩，因光罩可於「光罩支架：銷」橫向滑動，故光罩可能有自適當位置偏離之問題。依證據2整體結構配置，證據2「基部：下蓋」後側設有「後、側部定位元件：角(13)」，以防止光罩在後側向左右移動。

(二)證據2揭露導引與定位光罩技術特徵：

1.證據2有同斜角邊緣之彎曲弧線結構：

依證據2整體結構配置，由於「蓋部：上蓋(1)」前側設有「光罩定位凸片：前側之壓腳(11)」，「蓋部：上蓋」與「基部：下蓋(2)」結合過程，而於光罩偏移時「光罩定位凸片：前側之壓腳」彎曲結構部分，將會接觸光罩，因而自前方、左方、右方推動光罩，往後方、右方、左方之方向；光罩受推動後，將與相對方向壓腳之隅角部分嚙合，而受隅角部分固持。訴願決定肯認證據2 壓腳具有「斜角邊緣」，僅是認定斜角邊緣不明顯，非否認有此結構特徵之存在。而明顯與否，並非申請專利範圍之限定條件。參加人亦肯認證據2壓腳具有柱體底端「彎曲弧線」，在承認有「彎曲弧線」結構之前提，參加人僅爭執結構有何具體功能。且參加人不否認「壓腳之設置位置」在光罩盒之上蓋「前方」，壓腳彎曲弧線之設置位置可與系爭專利設置於上蓋前側「定位凸片之設置位置」，兩者相互對應。

2.證據2引導與定位光罩之功能：

－系爭專利之功效：

「壓腳(11)彎曲弧線」及「彎曲弧線結構之設置位置」，引

導、定位光罩之功能，係客觀事實之固有存在，揭露系爭專利相同之固有功能，應自整體觀察之，故所討論對象除「彎曲結構」具體結構、設置位置外，亦包含光罩盒整體基座元件、蓋部元件之整體配合，有無達成「前側壓腳之彎曲弧線」結構，迫使光罩橫向移動至與其他「左、右側壓腳之隅角」結構嚙合，並受「左、右側壓腳之隅角」結構固持功效。

—光罩盒整體之固有功效分析：

引證案與系爭專利兩者均未設置可完全防止光罩移動之基座結構，故在將光罩放置於水平光罩支架上時，「自適當位置光罩偏移」問題有待解決。

「自適當位置光罩偏移」時，倘需加以定位與導正，具有功效之結構，必須設置在「光罩偏移時與光罩嚙合」設置位置，始能發揮作用。引證案基座之後側設置有「基座後側之角(13)」，故光罩放置於基座之銷(8)上時，可發生「光罩偏移」現象者，此時光罩偏移待導正。光罩在等待導正「前側、左側、右側」方向之偏移位置，引證案蓋部在與光罩嚙合之位置，設置有「壓腳(11)彎曲弧線」，在光罩無須導正之適當位置，引證案之蓋部在與光罩嚙合之位置，設置有「壓腳之隅角結構」。準此，當發生「光罩偏移」現象時，在偏移位置之光罩，會在蓋部下移時與「壓腳之彎曲弧線」嚙合。

證據2之文字雖未記載壓腳(11)具有彎曲弧線結構，然其圖式揭露存在之壓腳具有彎曲結構。關於彎曲弧線結構之功能，自參加人所主張之通常知識，足認「壓腳之彎曲弧線結構」藉由嚙合所發揮導引光罩移動之功能，其與系爭專利之光罩定位凸片斜角邊緣結構，具有相同之導引與定位功效。依

據證據2第90頁下右欄記載可知，「不致損傷光罩表面」及「防止傷痕產生」功能之材質特徵揭示，實質隱含技術內容：光罩與壓腳間可能發生相對滑動、發生摩擦，而可能產生傷痕，故有必要使用不致損傷光罩表面之材質。準此，光罩與壓腳間可能發生相對滑動及發生摩擦，係證據2實質隱含之技術內容。

．證據2揭示系爭專利結構特徵：

綜上所述，在引證案之上蓋結構及基座結構整體之組合，包含「容許光罩往前側偏移之下表面支撐結構」及「前側之壓腳(11)彎曲弧線結構」，揭示「斜角邊緣部之方向」結構特徵、「光罩定位凸片係被定位成與光罩之光罩中間相鄰隅角嚙合」設置位置特徵，因而揭示「可橫向滑動迫使光罩與光罩限制器嚙合」功能特徵。

3.通常知識者可由證據2知悉系爭專利功效：

證據2之圖式揭露與系爭專利相同之定位結構、設置位置，其與系爭專利相較，證據2「壓腳(11)彎曲結構」及「彎曲結構之設置位置」，均與系爭專利之定位凸片「斜角邊緣」及「斜角邊緣之設置位置」對應，在相同「光罩偏移期望位置時」待解決問題發生時，光罩均會因偏移而在「彎曲結構之設置位置」接觸「壓腳之彎曲結構」，因嚙合而固有發生凸輪作用之推抵功效。準此，證據2第2圖揭示「具有水平支撐光罩之光罩支架」，其固有光罩可在其上橫向滑動之待解決問題；而壓腳設置於蓋部，且壓腳具有朝向光罩盒內部之彎曲結構及具有光罩限制器之二段式結構，「設置於蓋部之朝向光罩盒內部之彎曲結構」，係固有引導、定位光罩至適當位置之功能，「設置於蓋部而恰於可於適當位置與光罩嚙

合之隅角結構」，係固有使光罩於適當位置固持之功能。換言之，無論證據2是否以文字記載彎曲結構之相關功效，其已揭露彎曲結構之構造及設置位置，其與系爭專利並無實質差異。此等結構接觸適當位置之偏移光罩，壓腳之彎曲弧線結構必然於接觸光罩時，隨蓋部與基部配合之過程，固有逐步導引、定位光罩至適當位置之功能。所屬技術領域中具有通常知識者自得知悉當蓋部與基部配合時，可藉由「設置於蓋部之朝向光罩盒內部之彎曲結構」，將於光罩支架上自適當位置偏移之光罩引導與定位，至與「設置於蓋部而恰於可於適當位置與光罩嚙合之隅角結構」嚙合之適當位置之功效。

4.固有性原則之判讀：

依固有性原則之判讀，應認證據2之圖式揭露與系爭專利完全相同或至少實質上相同之具體結構，設置於蓋部「光罩限制器、光罩定位凸片、二段式結構」，故揭露具體結構所固有之功能「允許初期較大之定位不精確」。系爭專利圖式之光罩限制器雖有繪製斜面，然並非申請專利範圍之限制條件，且其設置位置在系爭專利各圖式間並不一致，結構上為自由端，位置與定位凸片重疊而不可能與光罩嚙合。證據2之壓腳(11)揭示之彎曲弧線結構，設置在偏離光罩適當位置之位置，且為非活動之固定結構，故嚙合光罩時可發生推抵導引之功效。

(三)證據2揭露固持光罩技術與鎖固光罩盒特徵：

參加人同意證據2壓腳「隅角結構」可對應系爭專利之光罩限制器，參加人與其訴訟代理人均當庭承認之，證據2壓腳與系爭專利之光罩限制器具有相同結構，並具有相同之功能

可對應系爭專利之光罩限制器。準此，依證據2整體結構配置，「蓋部：上蓋(1)」左右設有「光罩限制器：左右二側之壓腳」，光罩到達定位與收納時，光罩被「光罩限制器：左右二側之壓腳」隅角結構固持。再者，依證據2整體結構配置，收納盒關閉時，收納盒兩側之突出板設置「閂鎖片：固定銷(5)」與下蓋兩邊設置「閂鎖凹槽：固定孔(6)」可結合，使「蓋部：上蓋」與「基部：下蓋(2)」鎖固。

二、證據2足證系爭專利為通常知識者能輕易完成：

(一)凸輪為通常知識：

1.依凸輪通常知識設計能達成物件特定移動路線之其他形狀：

依參加人於他案N01舉發案件更審前之主張可知，依參加人所宣稱，該領域之通常知識：無論「斜角」、「凸輪面」、「斜面」，均能自其設計曲面導引物件並定其移動路線，以達到迫使光罩橫向移動之功能。參加人於他案已承認光罩載具設計領域之人，均具備「通常知識：凸輪知識」，當應將此「通常知識：凸輪知識」於判斷進步性時一併考量。再者，參加人已承認「通常知識：凸輪知識」，本案本無須外求其他輔助證據證明系爭專利申請時之通常知識水準。職是，縱不審酌原告提出用以證明系爭專利申請時之通常知識水準「輔助證據：證據3、3-1、4、5及原證7」，仍應依專利權人所自承「通常知識：凸輪知識」續為審查系爭專利是否具進步性。

2.由習知技術歸納而得之通常知識：

判斷技術是否為通常知識、習知技術，應實質以技術是否為所屬技術領域之通念為斷，而非僅以形式審認技術係見於教科書中或見於專利文件。依據舉發審查基準第4.3.1.3.2節

「進步性或創作性審查注意事項」所載，就原告提出之證據應作如何用途、待證事實為何，應循原告所為主張作為判斷之標的，其與他案所主張之證據用途、待證事實均無涉。原告提出證據3、3-1、4、5及原證7等補強證據，係用於證明系爭專利申請時之通常知識水準，本應不涉及技術組合、非屬舉發證據。而利用具有凸輪作用表面之結構橫向導引收納物件，屢見於各個不同之收納盒之設計，除為機械領域習知技術，亦為光罩盒設計領域之習知技術，所周知、屘遍使用及從經驗法則所瞭解之通常知識，且技術領域上明顯共通。

3.光罩載具之有關技術領域：

補強證據3、3-1、4、5、原證7雖非屬與光罩載具技術領域相同之技術領域，然與光罩載具同屬半導體產業鏈之一環，自屬半導體產業之相關之技術領域。況光罩載具技術領域與電子零件載具技術領域或光罩護件載具技術領域間，僅係裝載物體不同，並不因裝載物體之差異而存在不同之待解決問題。申言之，光罩載具可直接套用電子零件載具或光罩護件載具技術內容之特殊特徵，兩者自屬相關之技術領域，而與光罩載具技術領域間具有關聯性。再者，證據4、5與系爭專利具有共通之技術特徵：以「具有凸輪作用表面之結構定位導引物體」，且凸輪知識依專利權人之自述，為「最基礎之機械設計之通常知識」，屬單純機械原理，並不涉及光罩、電子零件、光罩護件載具技術領域間之領域差異，而有互通通常知識之基礎，屬光罩載具技術領域之相關先前技術。

(二)通常知識者得依申請前先前技術輕易完成系爭專利：

具備凸輪通常知識之人，依證據2 揭露於蓋部設置可於蓋部與基部配合之過程中接觸光罩，並以凸輪作用達成物件特定

移動路線，自可輕易將證據2前側壓腳之彎曲結構「依據其專業知識設計出各種符合推動光罩橫向移動至定位之需求之光罩定位凸片形狀或結構」，完成與系爭專利相同之發明。置換後產生之功效，對於光罩載具所屬技術領域中具有通常知識者能夠預期。準此，光罩載具設計領域中具有通常凸輪知識之人，依照證據2所示「利用具有凸輪作用表面之結構橫向導引光罩」習知先前技術，當可設計出不同形狀之可用於定位之凸輪作用表面，可輕易將證據2之彎曲結構輕易變更為同為凸輪作用表面之斜角邊緣部。是光罩載具領域具有通常知識之人，依申請前之先前技術能輕易完成系爭專利之發明，系爭專利不具進步性。

三、固有性之判斷：

我國審查、司法實務已將源自美國之固有性(inherency)概念引入新穎性、進步性之判斷，認同「物」於科學上本質所固有之功能，乃該「物」實質上隱含之內容，屬能自圖式直接且無歧異得知之內容，且可用於比對進步性。依固有性之概念，因功能為結構固有之內容，除無需審認引證文件是否記載功能外，亦無須審認先前技術發明之本意為何。

(一)固有性原則一：

功能為結構固有之內容，故審究新穎性、進步性之對象判斷對象為結構是否相同，而非功能是否相同。是應將證據2揭露之柱體底端彎曲弧線「結構」與系爭專利揭露之斜角邊緣「結構」比對，至於結構所固有之引導、定位光罩「功能」並非判斷新穎性、進步性之審究對象。

(二)固有性原則二：

系爭專利就結構所固有「功能」所為多餘敘述，不影響新穎

性、進步性之判斷，縱系爭專利就光罩定位凸片之斜角邊緣所固有之引導、定位光罩功能另為文字描述，亦屬就光罩定位凸片之斜角邊緣所固有之功能所為多餘敘述。縱證據2未就「柱體底端彎曲弧線」結構所固有之引導、定位光罩功能多為描述，仍不影響新穎性、進步性之判斷。

(三)固有性原則三：

固有性為一事實問題，僅須事實上固有，至先前技術形式上是否揭露、發明目的是否為固有之功能而發，均非所問。是證據2壓腳「柱體底端彎曲弧線」結構於事實上、本質上，為固有結構於科學上必然存在之功能，無論證據2發明之核心技術特徵、所欲解決之問題、證據2發明人內心之目的是否包含引導、定位光罩，均非所問，不應以此否認證據2壓腳「柱體底端彎曲弧線」結構，確實固有引導、定位光罩功能之事實問題。

(四)固有性原則四：

「物」科學上本質之固有「功能」屬固有性揭露，是證據2揭露之壓腳具體結構及光罩盒整體結構配置，為科學上固有引導、定位光罩之功能。將光罩放置於水平光罩支架上時，為固有「光罩自適當位置偏移」所待解決問題；證據2與系爭專利之蓋部均設置壓腳、光罩定位凸片，係固有壓腳必然於光罩偏移時接觸光罩之結果；證據2之壓腳及系爭專利之光罩定位凸片均具「凸輪作用表面」。故結構接觸自適當位置偏移之光罩，固有壓腳必然於接觸時，隨蓋部與基部配合之過程，逐步導引、定位光罩至適當位置之功能。

(五)光罩被橫向推動為結構固有與必然存在之結果

證據2之壓腳彎曲結構設置於光罩收納盒之蓋部，且其設置

之上下高度、左右相對位置，乃設置為「倘光罩偏移時將碰觸光罩」高度及相對位置，為明確揭示之內容。是彎曲結構設置於該部位，必然實質隱含於光罩偏移時，在蓋部向下與基部配合之過程中接觸光罩，並隨蓋部繼續向基部降落之過程中提供一向下正向力施加於光罩，而正向力作用於光罩時，依照科學原理，必然產生一水平分力，而將推動光罩橫向移動，不可能用於參加人所辯之防止刮手功能。準此，所屬技術領域中具有通常知識者參酌申請時之通常知識，必然得出「光罩被橫向推動」結果，「光罩被橫向推動」為結構固有、必然存在之結果，為此結構直接無歧異之解釋。

四、證據2不具有反向教示：

(一)證據2無壓腳不可用於引導與定位光罩之教示：

證據2未記載「壓腳別無其他功能」，亦無「壓腳不可用於引導、定位光罩」教示。倘該先前技術兼有複數功能，因專利文件未鉅細靡遺例舉所有功能，而僅擇一強調單一功能，未明確排除其他功能，並非「反向教示」。查證據2第90頁下右欄之文字固記載：第2圖係在收納盒中收納光罩之局部剖面圖，並在左右及前側設有壓腳，以防止光罩(10)在銷(8)上移動等語。然此段文字僅是單純未教示壓腳兼有引導、定位光罩功能之教示，並未記載排除「引導、定位光罩之功能」。準此，專利文件描述方式本不可能鉅細靡遺，而各份專利文件所強調之技術重點各有不同，導致就相同「功能」描述之詳細程度不一，除不能否認先前技術之圖式所揭露之結構外，亦不能否認結構依其具體形狀、所設置位置，對整體發明之技術意義。

(二)同一部件之不同部分可分別具有不同功能：

同一部件上具有推動功能之部分，其與具有限制功能部份，兩者係可解釋為不同部分。專利權人於另案民事訴訟中，主張該案所爭侵權產品之同一構件之不同部分，分別具有「滑動接觸點」部分可引導與定位光罩，暨具有可施加向下壓力之部分可限制光罩移動。準此，參加人認同同一部件之不同部分可分別具有不同功能。

參、被告聲明請求駁回原告之訴，並答辯略以：

一、被告審查符合進步性審查程序：

被告原處分於舉發案之進步性判斷過程，透過審定書敘述證據是否足以證明系爭專利請求項不具進步性之論理，符合進步性審查基準規定，且審定書第6至15頁已就舉發證據與系爭專利請求項進行比對差異，並說明否定進步性因素不足之理由，符合進步性之審查步驟。且被告原處分清楚記載系爭專利請求項所載技術內容與舉發證據之比較，暨舉發證據未揭露系爭專利之技術特徵，對於所屬技術領域具有通常知識者無法依據舉發證據之內容輕易完成。

二、系爭專利未違反專利法規定：

系爭專利請求項「橫向滑動迫使」及「光罩限制器」文字，在系爭專利相關之舉發案件，被告之審定理由、經濟部訴願決定及本院行政訴訟判決均有說明，並無違反專利法規定，是本件起訴理由係就原處分記載形式上是否對所有詞彙進行解釋，作為判斷是否符合審查基準規定，容有誤解。

三、系爭專利具新穎性與進步性：

被告之審定理由說明證據2之技術內容，未揭露系爭專利之技術特徵，並就證據2、3、3-1、4、5所構成之各舉發爭點，逐一敘明不足證明系爭專利不具新穎性及進步性之理由。

四、證據2不足證系爭專利不具新穎性與進步性：

查證據2未揭示系爭專利之光罩限制器，且證據2係利用抵持件(11)頂端凸出及側邊與光罩(10)邊緣限制定位，而系爭專利利用蓋部與基部配合時，光罩定位凸片之斜角邊緣部方向，係可橫向滑動迫使光罩與光罩限制器嚙合，兩者定位嚙合之構造不同，證據2不足以證明系爭專利請求項1、6、12不具新穎性。因證據2未揭示系爭專利「光罩係可在其上橫向滑動」、「光罩定位凸片」、及「各光罩定位凸片具有一斜角邊緣部，當蓋部與基部配合時，斜角邊緣部之方向可橫向滑動迫使光罩與該光罩限制器嚙合，光罩定位凸片係被定位成與光罩之光罩中間相鄰隅角嚙合」技術特徵，且該領域具有通常知識者無法依據證據2 之內容，輕易完成系爭專利之所有技術特徵，故證據2不足以證明系爭專利請求項1、6、12不具進步性。再者，系爭專利請求項3、4、7、9、10、13、17，均直接或間接分別依附於請求項1、6、12，該附屬項為請求項1、6、12之進一步限縮，且包含請求項1、6、12之所有技術特徵，故證據2無法證明系爭專利請求項3、4、7、9、10、13、17不具新穎性及進步性。

五、原證7不足證系爭專利不具新穎性與進步性：

原告提出之實物盒係其自行製作之物品，並非證據2之相關者製造之實物，其製造日期應於系爭專利優先權日後，故實物盒不具證據能力。原證7與證據2為相同之申請人，其揭露之光罩盒圖式與證據2類似，證據2與原證7之補強證據無法證明系爭專利請求項1、3、4、6、7、9、10、12、13、17不具新穎性及進步性。

六、系爭專利請求項之解釋：

本院於準備程序庭諭示「橫向滑動迫使」為迫使光罩橫向滑動，「光罩限制器」為用於限制光罩移動之部件。且「光罩定位凸片」文字解釋在系爭專利相關之舉發案件，本院行政訴訟判決均已有清楚說明「光罩定位凸片」為向下移動使斜角邊緣部迫使光罩橫向滑動與光罩限制器嚙合。

肆、參加人聲明請求駁回原告之訴，並答辯略以：

一、系爭專利請求項之解釋：

(一)橫向滑動迫使與光罩定位凸片部分：

關於請求項所記載「橫向滑動迫使」及「光罩定位凸片」，以系爭專利請求項第1項之整體內容為例說明可知，「光罩」可在光罩支架上「橫向滑動」，而「光罩定位凸片及其斜角邊緣部」，係在蓋部與基部配合時，可迫使光罩橫向滑動使光罩與光罩限制器嚙合。而光罩定位凸片之位置，受請求項1「蓋部具有一內表面，其上突設有光罩定位凸片」進一步限定，其餘獨立項中亦有類似之界定。對於請求項之解釋，除請求項整體內容外，仍有不明，應以系爭專利之說明書與圖式「內部證據」作為解釋之依據。依系爭專利說明書之發明內容、實施方式、圖式揭示可知，系爭專利請求項第1、6、12項「橫向滑動」以達到定位者為「光罩」，而「光罩定位凸片」係當蓋部與基部相互配合時，可迫使光罩橫向滑動到達可被光罩限制器嚙合之位置。再者，參加人已說明本院104年度民專訴字第36號關於參加人控告原告侵害專利權案件，已針對系爭專利請求項「橫向滑動迫使」，係指「光罩定位凸片迫使光罩橫向滑動」有所解釋，而原處分對於系爭專利之請求項「光罩定位凸片迫使光罩橫向滑動」技術特徵之認定，其與本件認定一致。

(二)光罩限制器部分：

關於請求項所記載「光罩限制器」，依據系爭專利說明書之揭露：光罩限制器(142)在內表面(141)上之位置、彈力臂(143)長度可協同選擇，使得每一光罩嚙合部(145)可嚙合，並限制位於光罩支架(122)上之光罩(200)上部隅角等語。依據系爭專利說明書，光罩限制器在幾何位置與形狀上可選擇，用以當蓋部嚙合基部時，施加一向下偏壓力於光罩上，其主要目的在於提供於光罩到達基部定位後持續「固持」光罩於定位上之效果。請求項2與說明書中所述之複數對彈力臂，是例示之下位特徵。職是，本領域具通常知識者可理解「光罩限制器」係一種用以「固持」光罩之結構。

二、整體審查原則：

進步性之審查應以整體審查為原則，且應避免後見之明，不得僅針對個別或部分技術特徵與前案比對為進步性之判斷，更不應以後見之明，作成專利之發明能輕易完成而不具進步性之決定。原告明知證據2之目的、技術手段、結構及效用均與系爭專利整體有不同之情況，其就證據2之主張不僅違反整體比對原則，更顯係基於後見之明所為。

三、證據2未揭露或教示系爭專利之請求項1、6及12：

(一)證據2無隅角結構及彎曲結構2元件：

遍觀證據2全文，並無「隅角結構」及「彎曲結構」元件名稱，亦無有關「收納時僅隅角結構接觸光罩」及「令光罩沿彎曲結構推抵至定位」等描述。

(二)應避免後見之明：

對引證文件揭露程度要求之目的在於避免後見之明，倘先前技術之某部分內容揭露不明確，具有歧異解讀之可能性時，

應將該揭露不明確部分，排除於適格之先前技術揭露之證據範圍外，而不應依據系爭專利之揭露或教示，去反向推想先前技術之內容應為何者，否則必將落入後見之明。

(三)證據2未揭露系爭專利技術：

系爭專利所屬技術領域之通常知識者，無法從證據2所揭露者直接無歧異得知或是輕易思及「光罩可在凸柱上橫向滑動」。依據證據2之內容可知，證據2所有關於抵持光罩之元件，均為「不讓光罩偏移」、「讓光罩不移動」。證據2第3圖揭露角之設置，顯然是使光罩在放置時直接下落到定位。職是，參加人遍查證據2全文，僅見抵持部(11)與角均為用來防止光罩移動，並未揭露可斜緣推送、橫向移動光罩、 頂端角落固持。

(四)系爭專利可解決先前技術所生之問題：

系爭專利可在光罩未放置於可被光罩限制器固持之位置時，以光罩定位凸片橫向滑動光罩至適當定位，尤以系爭專利之技術手段係可容忍光罩在基座上水平移動一段距離，利用蓋部上之光罩定位凸片推動其至基部之預定位置、利用「光罩限制器」對已到達預定位置之光罩加以固持。反觀證據2僅強調防止光罩移動或橫向滑動，尤以證據2係利用設置於該盒之前側及兩側之元件(11)及設置於該盒之後側之角(13)防止光罩橫向移動。

四、證據3、3-1、4、5及原證7非補強證據：

原告利用人頭分別提起N01至N06多個舉發案件，並於各舉發案件之行政訴訟程序中不斷提出新證據。本案中證據3、3-1、4、5、7多數證據，均已由本院之他案判決認定不足以使系爭專利無效，原告不得於本案中再以該等證據爭執系爭專

利有效性。補強證據僅得用於增強或擔保舉發證據之證據能力或證明力，且不應用於撤銷專利之獨立證據，是證據3、3-1、4、5及原證7顯非補強證據。準此，舉發證據與補強證據於法律層面之定義上顯具差異，證據3、3-1、4、5及原證7並非補強證據。

五、證據3、3-1、4、5及原證7未揭露請求項1、6、12：

(一)證據3未揭露系爭專利請求項1、6 及12：

依據證據3揭露內容可知。因倒角係被設置圍繞光罩(105)下邊緣，且支撐件(112)係沿下邊緣之倒角，光罩之側向移動將會被四支撐件所限制。原告雖主張證據3揭露「採用其他支撐結構來接觸及支撐光罩，且/或可接觸光罩之下表面」，然證據3未說明或圖式揭露光罩可在支撐件上橫向滑動。本領域具通常知識者閱讀證據3之內容，僅能得到光罩必須在蓋部與基部配合前，就先被穩固定位於基部之印象。是證據3未揭露「一基部，具有至少一對相間隔之光罩支架，當光罩置於光罩支架上時，光罩支架被定位且適於接觸及支撐光罩之下表面，光罩係可在其上橫向滑動」技術特徵。再者，依據系爭專利請求項1之整體與證據3之比較，可清楚瞭解證據3未揭露或教示系爭專利之請求項1之具體特徵，自無揭露其他獨立請求項中關於利用可以橫向推動光罩之蓋部之光罩定位凸片，迫使光罩移動至定位，並進一步與光罩限制器嚙合之技術特徵。

(二)證據3-1未揭露系爭專利請求項1、6及12：

證據3-1未揭露或教示請求項1「一基部，具有至少一對相間隔的光罩支架，當光罩置於光罩支架上時，光罩支架被定位且適於接觸及支撐光罩之下表面，光罩係可在其上橫向滑動

」特徵。證據3-1未揭露系爭專利請求項1所記載「一蓋部，用於緊密配合基部，蓋部具有一內表面，其上突設有複數個相間隔之光罩限制器及一對光罩定位凸片，各光罩定位凸片具有一斜角邊緣部，當蓋部與基部配合時，斜角邊緣部之方向係可橫向滑動迫使光罩與光罩限制器嚙合，光罩定位凸片係被定位成與光罩之光罩中間相鄰隅角嚙合」技術特徵。

(三)證據4未揭露系爭專利請求項1、6及12：

證據4 並非光罩載具之技術領域，欲解決之技術問題顯非相同。證據4 之內容係關於將電子連接器放置於基板上預定位置之技術。證據4之技術內容與系爭專利之技術無關，解決之技術問題不同。光罩載具領域之通常知識者不可能有動機主動參酌證據4之技術內容製作光罩載具。證據4與系爭專利技術無關，且證據4未揭露系爭專利之技術特徵。證據4之板對板連接器與系爭專利之光罩並不對應。且板對板連接器有接腳，必須焊接於印刷電路板上，而非收納於載具中。證據4沒有用於收納板對板連接器載具之蓋部與基部之揭露，遑論揭露利用蓋部之定位凸片推動其與另一限制器嚙合。職是，證據4未揭露或教示系爭專利之請求項1，亦未揭露請求項6與12。

(四)證據5未揭露系爭專利請求項1、6及12：

證據5係關於貼附保護膜製程中使用之外框，其與光罩載具或者任何物品之載具無關。證據5未揭露或教示系爭專利請求項1記載「一蓋部，用於緊密配合基部，蓋部具有一內表面，其上突設有複數個相間隔之光罩限制器及一對光罩定位凸片」及「斜角邊緣部之方向係可橫向滑動迫使光罩與光罩限制器嚙合，光罩定位凸片係被定位成與光罩之光罩中間相

鄰隅角嚙合」特徵。準此，證據5除未揭露系爭專利請求項1外，亦未揭露請求項6與12。

六、原證7未揭露系爭專利之請求項1、6及12：

原證7僅有「限制光罩前後左右移動」、「為阻止光罩在pin上之移動」因此設置多個壓制件(11)、「為不使光罩在前後左右方向上移動」而設置爪(13)關於「極力限制光罩前後左右移動」方式之敘述，並無允許光罩於基座上橫向移動、利用蓋部內表面上突出之定位凸片推動光罩於基座上橫向移動一段距離到達預定位置等技術揭露。在系爭專利優先權日當時之本領域具有通常知識者，看到原證7之揭露，絕無可能思及系爭專利之技術，原證7未揭露系爭專利請求項1、6及12。

伍、本院得心證之理由：

一、整理當事人爭執與不爭執事項：

按受命法官為闡明訴訟關係，得整理並協議簡化爭點，民事訴訟法第270條之1第1項第3款、第463條分別定有明文，行政訴訟法第132條準用之。職是，法院於言詞辯論期日，依據兩造主張之事實與證據，經簡化爭點協議，作為本件訴訟中攻擊與防禦之範圍（見本院卷一第297至316頁之109年1月14日之準備程序筆錄）。

(一)不爭執事項：

參加人前於92年7月3日以「標線載具」，後更名為「光罩載具及支撐光罩之方法」，向被告申請發明專利，並以2002年7月5日申請之美國第10/190,347號專利案主張優先權。經被告編為第00000000號審查，而於98年8月21日准予專利，申請專利範圍共20項，並發給系爭專利證書。嗣原告於107年5

月4日以系爭專利請求項1、3、4、6、7、9、10、12、13及17，有違核准時專利法第22條第1項第1款及第4項規定，對之提起舉發(N04)。被告嗣以參加人在另案舉發(N03)案提出之107年6月13日說明書及申請專利範圍更正本，業經被告於108年1月16日之審定准予更正，本件舉發(N04)案依更正本進行審查，並核認系爭專利請求項1、3、4、6、7、9、10、12、13及17，未違反前揭專利法規定，並於108年1月23日為「請求項1、3至4、6至7、9至10、12至13、17舉發不成立」處分。原告不服而提起訴願，經濟部嗣於108年7月3日訴願決定駁回，原告不服訴願，遂向本院提起行政訴訟。

(二)主要爭執事項：

當事人主要爭執事項如後：1.系爭專利請求項記載「橫向滑動迫使」、「定位凸片」及「光罩限制器」，應如何解釋；2.原告提出之舉發證據，是否足以證明系爭專利請求項1、3、4、6、7、9、10、12、13、17不具新穎性與進步性，而違反核准時專利法第22條第1項第1款與同條第4項規定？

二、判斷系爭專利之有效性與順序：

按凡可供產業上利用之發明，無申請前已見於刊物或已公開使用者，得依本法申請取得發明專利。發明雖無申請前已見於刊物、申請前已公開實施者、申請前已為公眾所知悉者，然為其所屬技術領域之具有通常知識者，依申請前之先前技術所能輕易完成時，仍不得取得發明專利。92年2月6日修正公布，93年7月1日施行之專利法第22條第1項第1款、第22條第4項定有明文。因系爭專利之申請日為92年7月3日，公告日為98年12月1日，故本件關於系爭專利有無具備進步性要件之判斷，應依核准審定時有效之92年2月6日修正公布，93

年7月1日施行之專利法為斷（下稱審定時專利法）。本院審酌當事人主要爭執事項，首應說明系爭專利技術之技術特徵，並說明舉發證據之技術特徵；繼而探究系爭專利請求項記載「橫向滑動迫使」、「定位凸片」及「光罩限制器」之解釋；最後分析系爭專利之專利有效性，判斷舉發證據是否足以證明系爭專利請求項1、3、4、6、7、9、10、12、13、17不具新穎性與進步性，而違反核准時專利法第22條第1項第1款與同條第4項規定。

三、系爭專利技術之分析：

(一)系爭專利技術內容：

一種光罩載具，使用於光微影半導體製程，具有一基部與一蓋部。基部具有複數個光罩支架及複數個光罩定位部件。蓋部用於緊密配合基部，並具有一內表面，其向內突設有複數個相間隔之光罩限制器及一對光罩定位凸片，各光罩定位凸片具有一斜角邊緣部，當蓋部與基部配合時，可使斜角邊緣部迫使光罩支架上之一光罩與光罩限制器嚙合。

(二)系爭專利請求項分析：

參加人於107年6月13日申請更正系爭專利請求項，經智慧財產局審查核准，並於108年2月21日公告，系爭專利公告本所載請求項共20項，第1、6、12、19為獨立項，其餘為附屬項，系爭專利主要圖式，如附圖1所示。茲說明原告所爭執之請求項內容如下：

1.請求項1之內容：

一種光罩載具，用於承載光微影半導體製程中所使用的光罩，光罩通常係平面，具有相對的上表面及下表面及四個隅角，載具包括：－一基部，具有至少一對相間隔之光罩支架，

當光罩置於光罩支架上時，光罩支架被定位且適於接觸及支撐光罩之下表面，光罩可在其上橫向滑動；一蓋部，用於緊密配合基部，蓋部具有一內表面，其上突設有複數個相間隔之光罩限制器及一對光罩定位凸片，各光罩定位凸片具有一斜角邊緣部，當蓋部與基部配合時，斜角邊緣部之方向可橫向滑動迫使光罩與光罩限制器嚙合，光罩定位凸片係被定位成與光罩之光罩中間相鄰隅角嚙合。

2.請求項3與4之內容：

請求項3如請求項1之光罩載具，其包含至少一閂鎖機構，用於將蓋部鎖固至基部。請求項4如請求項1之光罩載具，其中各光罩支架包含一自基部向上突出之肋條。

3.請求項6之內容：

一種光罩載具，用於承載光微影半導體製程中所使用之通常為平面之光罩，包括：－一基部，具有複數個光罩支架，當光罩置於光罩支架上時，光罩支架適於接觸及支撐光罩之下表面；一蓋部，用於緊密配合基部，蓋部具有一內表面、複數個光罩限制器及至少一自內表面突出之光罩定位凸片，當蓋部與基部配合時，光罩定位凸片適用於橫向滑動迫使光罩與光罩限制器嚙合。

4.請求項7與9至10之內容：

請求項7如請求項6之光罩載具，其中光罩定位凸片具有一斜角邊緣部，當蓋部與該基部配合時，斜角邊緣部之方向可與光罩支架上之一光罩之上邊緣嚙合。請求項9如請求項6之光罩載具，其包含至少一閂鎖機構，用於將蓋部鎖固至基部。請求項10如請求項6之光罩載具，其中各光罩支架包含一自基部向上突出之肋條。

5.請求項12之內容：

一種光罩載具，用於承載通常為平面的光罩，包括：－一基部，具有複數個光罩支架，當光罩置於光罩支架上時，光罩支架適於接觸及支撐光罩之下表面；—一蓋部，用於緊密配合基部，蓋部具有一內表面、複數個光罩限制器及用於當蓋部與基部配合時，橫向滑動定位光罩使其與光罩限制器嚙合之自內表面突出之光罩定位凸片。

6.請求項13與17之內容：

請求項13如請求項12之光罩載具，其中各凸片具有一斜角邊緣部，當蓋部與基部配合時，斜角邊緣部之方向可與光罩支架上之一光罩的上邊緣嚙合。請求項17如請求項12之光罩載具，其中各光罩支架包含一自基部向上突出之肋條。

四、證據技術分析：

按關於撤銷、廢止商標註冊或撤銷專利權之行政訴訟中，當事人於言詞辯論終結前，就同一撤銷或廢止理由提出之新證據，智慧財產法院仍應審酌之。智慧財產專責機關就前項新證據應提出答辯書狀，表明他造關於該證據之主張有無理由，智慧財產案件審理法第33條第1 項、第2 項定有明文。所謂新證據，係指就同一撤銷理由所提之新證據，而對於補強證據證明力之補強證據，除有礙訴訟終結之情形外，自得於事實審言詞辯論終結前隨時提出，行政法院就補強證據自應盡上開調查證據，認定事實之職責（參照最高行政法院107年度判字第163號行政判決）。查原告提出證據3、3-1、4、5及原證7證據之目的，係補強證明證據2是否足以證明系爭專利請求項1、3、4、6、7、9、10、12、13、17不具新穎性與進步性，而違反核准時專利法第22條第1項第1款與同條第

4項規定，本院就該等補強證據自應盡調查證據，以認定系爭專利是否不具新穎性與進步性。

(一)證據2技術內容：

證據2為1984年10月23日公開之日本第00-000000號專利案，公開日早於系爭專利優先權日2002年7月5日，可為系爭專利相關之先前技術。證據2為一種光罩盒，光罩(10)係收納於盒內，在左右側及前側（光罩取出方向）設有抵持件(11)，以防止光罩在凸柱(8)上移動（參照證據2第90頁右下區塊第2行及圖2），證據2圖式，如附圖2所示。

(二)證據3技術內容：

證據3為2002年6月6日公開之美國第2002/0000000號「SMIF CONTAINER INCLUDING AND ELECTROSTATIC DISSPATIVE RETICLE SUPPORT STRUCTURE」專利案，公開日早於系爭專利優先權日2002年7月5日，可為系爭專利相關之先前技術。本發明為一種用於光罩或矽晶圓之支撐結構，支撐結構包含一支持柱及一保持結構。除固定晶圓外，本發明更具有一放電路徑以移除來自晶圓之靜電，保持結構機械式嚙合每一個支持柱以產生一自晶圓到接地之放電路徑，晶圓之靜電經由支撐結構到支持柱並經由盒門(door)離開SMIF盒（參照摘要中譯）。證據3圖式，如附圖3所示。

(三)證據3-1技術內容：

證據3-1為2001年4月17日公告之美國第0000000號「SMIFCONTAINER INCLUDING A RETICLE SUPPORT STRUCTURE」專利案，證據3-1公告日早於系爭專利優先權日2002年7月5日，可為系爭專利相關之先前技術。一種主光罩支撐機構，其中一主光罩可快速且輕易之設置與卸下，且其能夠穩固支撐一主

光罩，用以儲存與輸送。本發明之一較佳之實施例包括一對主光罩支撐件，固定於容器之一門上，暨一對主光罩保留器固定於容器之一外殼上。當容器外殼於容器門相聯結時，主光罩支撐件及主光罩保持器之部分嚙合主光罩之斜角邊緣，且將主光罩夾在容器中之一固定位置上。結果於其斜角邊緣嚙合主光罩，可避免與該主光罩之上部及下部表面及垂直邊緣之可能有害接觸（參照摘要中譯）。證據3-1圖式，如附圖4所示。

(四)證據4技術內容：

證據4為1997年3月28日公開之日本第9-83127號專利案，公開日早於系爭專利優先權日2002年7月5日，可為系爭專利相關之先前技術。本發明提供一種可矯正連接器等電子零件之位置之電子零件之位置矯正方法及位置矯正用治具。在印刷於基板(1)焊錫膏(Cream Solder)附近塗布UV系黏著劑(5a、5b)後，在此等之上放置B-B連接器(6、7)將其投入錫爐前，藉由位置矯正用治具(15)矯正B-B連接器之位置，同時藉由紫外線使UV系黏著劑硬化而固定B-B連接器。且前述位置矯正用治具具有：支撐構件(12)、位置矯正用板(11)、位置矯正具(13、14)，藉由支撐構件支撐基板後安裝位置矯正用板，並將位置矯正具插入位置矯正用板之位置矯正用孔(11i、llj)，藉由位置矯正具(14)相對面(14a、14b)及位置矯正具(13)傾斜面(13a)進行位置矯正（參照摘要）。證據4圖式，如附圖5所示。

(五)證據5技術內容：

證據5為1995年9月26日公開之日本第0-000000號專利案，公開日早於系爭專利優先權日2002年7月5日，可為系爭專利相

關之先前技術。證據5技術之目的，提供一種可輕易進行在光罩上張貼護件之工序的護件盒。本發明之護件盒具備：保持板(3)，其係包含：放置面(3C、3D)，其供作為護件構成要素之框架(1)用於張設薄膜(2)側之端面(1C、1D)放置其上；抵接部(3A)，其抵接於框架1外周面(1A)而將框架定位；可裝卸之蓋(6)，其將護件收納於其與保持板間（參照摘要）。證據5圖式，如附圖6所示。

(六)原證7技術內容：

原證7為1985年5月31日公開之日本第00-00000號專利案，公開日早於系爭專利優先權日2002年7月5日，可為系爭專利相關之先前技術。本發明之構造並非將光罩直接入收納棚架，而係採取將光罩逐片置入盒中，再將複數個光罩盒置入收納棚架。第1圖係顯示本發明一個實施例之防塵光罩盒立體圖。光罩盒為便當盒方式，形成上蓋(1)與下蓋(2)可分離之構造。圖2是光罩(10)收納於盒裡之局部剖面圖，在左右側及前側（光罩取出方向）設有抵持件(11)，以防止光罩在銷(8)上移動。從圖上可明瞭抵持部之金屬爪，配合光罩尺寸設為略可彎曲的厚度，可極力防止光罩在盒內移動。圖3係從盒側面觀看的剖面圖，設有抵持件11，在光罩置入盒內時，避免光罩向左右及前後移動，在盒後側需要按住光罩，因而加以改變而安裝有爪(13)，使其在後側也不會移動。爪(3)採用可稍微彎曲的構造，可按住光罩避免其在盒內移動（參照更證4-1第76至77頁）。原證7圖式，如附圖7所示。

五、系爭專利請求項記載之解釋：

(一)解釋專利請求項之原則：

按發明專利權範圍，以申請專利範圍為準，而於解釋申請專

利範圍時，並得審酌說明書及圖式，核准時專利法第58條第4項定有明文。由於文字用語之多義性及理解之易誤性，因此解釋申請專利範圍時，固得審酌說明書及圖式，並應就專利說明書整體觀察，以瞭解發明之目的、作用及效果。因申請專利範圍係就說明書中所載實施方式或實施例作總括性之界定，圖式之作用僅係在補充說明書文字不足之部分，使發明所屬技術領域中具有通常知識者閱讀說明書時，得依圖式直接理解發明各個技術特徵及其所構成之技術手段，故參酌說明書之實施例及圖式所為之申請專利範圍解釋，應以申請專利範圍之最合理寬廣之解釋為準，除說明書中已明確表示申請專利範圍之內容，應限於實施例及圖式外，自不應以實施例或圖式加以限制，而變更申請專利範圍對外公告而客觀表現之專利權範圍（參照最高行政法院106年度判字第634號、107年度判字第154號行政判決）。準此，申請專利範圍用語應如何解釋，為本院應依職權認定之事項，不受兩造及參加人主張之拘束。

(二)系爭專利請求項「與該複數個光罩限制器嚙合」應解釋為「與該複數個用於限制光罩移動之部件嚙合」：

1.系爭專利請求項1、6及12之技術特徵：

系爭專利請求項1記載：蓋部具有一內表面，其上突設有複數個相間隔之光罩限制器，當蓋部與基部配合時，斜角邊緣部之方向可橫向滑動迫使光罩與光罩限制器嚙合。系爭專利請求項6記載：蓋部具有一內表面、複數個光罩限制器，當蓋部與基部配合時，光罩定位凸片適用於橫向滑動迫使光罩與光罩限制器嚙合。系爭專利請求項12記載：蓋部具有一內表面、複數個光罩限制器及用於當蓋部與該基部配合時，橫

向滑動定位光罩使其與光罩限制器嚙合。

– 系爭專利說明書之先前技術：

系爭專利說明書之先前技術第3段記載：光罩通常係以手動方式被定位於殼體內部之支承表面上，藉由殼體內部所附設之限制部件，將光罩嚙合並更緊密限制其移動。此等限制部件典型，係設計成可嚙合於光罩之邊緣處。此將產生一問題，最初以手動方式將光罩定位在支承表面上者，可能無法將光罩放置在適當位置以便與限制部件嚙合，或者在光罩被限制部件嚙合前，可能會不小心使光罩從適當位置偏移。倘光罩之位置偏移超過一定距離，限制部件可能會嚙合在其表面上、而非嚙合其邊緣，將導致光罩產生刮傷或其他物理損壞。

— 系爭專利說明書之發明內容：

系爭專利說明書之發明內容第1段及第2段末2行記載：本發明提供一種適當定位一載具中之光罩的裝置，使其與光罩限制器嚙合，同時減少光罩限制器致使光罩表面損壞的機會。利用本發明，光罩於光罩支架上之手動定位可較不精確，允許較大之誤差容許度。當蓋部進一步向下移動以嚙合基部時，光罩被自我定位凸片之斜角邊緣推至適當位置。

· 系爭專利說明書之實施方式：

系爭專利說明書之實施方式第4段記載：光罩限制器(142)在內表面(141)位置、彈力臂(143)長度可協同選擇，使得每一光罩嚙合部(145)可嚙合，並限制位於光罩支架(122)光罩(200)上部隅角。光罩限制器幾何形狀與位置之選擇，必須使每一光罩限制器輕微偏轉，當蓋部(140)完全嚙合基部(120)時，其可施加一向下偏壓力於光罩上。

2.光罩限制器於光罩被適當定位後用於限制光罩移動之部件：

－複數個光罩限制器：

參諸系爭專利說明書及請求項記載之內容，並參酌申請時之通常知識，審視系爭專利請求項之相關整體內容時，當能瞭解系爭專利為關於光罩載具之發明，其藉由光罩定位凸片適當定位一光罩載具中之光罩裝置，使其與光罩限制器嚙合，以減少習知之光罩從適當位置偏移超過一定距離，光罩限制器致使光罩表面損壞的機會。簡言之，光罩限制器係於光罩被適當定位後，用於限制光罩移動之部件。是系爭專利請求項記載：複數個光罩限制器一詞。應解釋為「複數個用於限制光罩移動之部件」。系爭專利請求項記載「與該複數個光罩限制器嚙合」一詞，應解釋為「與該複數個用於限制光罩移動之部件嚙合」。

—客觀上最合理寬廣之範圍：

原告雖主張：請求項文字之複數個光罩限制器，應解釋為共同界定一適當位置，並限制光罩自該適當位置移動之複數部件，請求項文字「與該複數個光罩限制器嚙合」應解釋為「與該複數個光罩限制器在該適當位置嚙合」云云。惟系爭專利關於光罩載具之發明，其藉由光罩定位凸片適當定位一光罩載具中之光罩的裝置，使其與光罩限制器嚙合，以減少習知之光罩從適當位置偏移超過一定距離，光罩限制器致使光罩表面損壞之機會。換言之，系爭專利專利說明書之發明內容、實施方式及申請專利範圍，未記載藉由光罩載具「蓋部之複數個光罩限制器共同界定一適當位置」，且系爭專利專利說明書之實施方式明確記載：本發明之範圍為由隨附之申請專利範圍及其法定均等範圍所限定，而並非由上述範例所

限制。職是，原告主張之解釋並無所據，不當限縮系爭專利請求項文字所界定之客觀上最合理寬廣之範圍，不足為憑。

(三)系爭專利請求項「橫向滑動迫使」，應解釋為「迫使光罩橫向滑動」。系爭專利請求項「光罩定位凸片」，應解釋為「適用於迫使光罩橫向滑動之定位凸片部件」：

1.系爭專利請求項1「橫向滑動」記載：

系爭專利請求項1關於「橫向滑動」記載包含有兩處：－光罩支架被定位且適於接觸及支撐光罩之下表面，光罩係可在其上橫向滑動，可知在光罩支架上橫向滑動之主體係光罩；—當蓋部與基部配合時，斜角邊緣部之方向係可橫向滑動，迫使光罩與光罩限制器嚙合。因方向本身並無橫向滑動之可能，由其上下文可知，其係指蓋部與基部相互配合，即蓋部與基部相互靠近時，蓋部上之斜角邊緣部具有一方向，方向可橫向地迫使光罩向光罩限制器靠近，亦位於蓋部。另參酌系爭專利圖6至9及說明書第9頁第19行至第10頁第5行：當蓋部(140)如圖7所示向下移動時，倘後表面(208)係與後部定位凸片(128)間隔開，自我定位凸片(150)斜角引導邊緣(152)會嚙合上光罩表面(202)與前光罩表面(204)所形成之隅角(210)。當蓋部如圖7與8所示向下移動時，隅角(210)沿斜角引導邊緣滑動，使得光罩(200)被推向後部定位凸片。當蓋部幾乎完全嚙合基部(120)時，隅角滑過隅角(170)，使得垂直邊緣部(172)嚙合前表面，如圖9所示已揭露「（蓋部）斜角邊緣部向下移動」及「（光罩定位凸片）斜角邊緣部之方向迫使光罩橫向滑動與光罩限制器嚙合」相關技術手段。準此，該發明所屬技術領域中具有通常知識者，依據說明書記載之內容，並參酌申請時之通常知識，審視系爭專利請求項

1之相關整體內容時，當能瞭解系爭專利請求項1「斜角邊緣部之方向，係可橫向滑動迫使光罩與光罩限制器嚙合」，所指是「斜角邊緣部之方向，為迫使光罩橫向滑動與光罩限制器嚙合」，故橫向滑動之主體係「光罩」。

2.系爭專利請求項6與12之橫向滑動與光罩定位凸片記載：

系爭專利請求項6「當蓋部與基部配合時，光罩定位凸片適用於橫向滑動迫使光罩與光罩限制器嚙合」。請求項12「當蓋部與基部配合時，橫向滑動定位光罩使其與光罩限制器嚙合之自內表面突出之光罩定位凸片」。職是，發明所屬技術領域中具有通常知識者，當能瞭解橫向滑動之主體係「光罩」，且光罩定位凸片適用於迫使光罩橫向滑動。故系爭專利請求項記載「橫向滑動迫使」，應解釋為「迫使光罩橫向滑動」。系爭專利請求項記載「光罩定位凸片」，應解釋為「適用於迫使光罩橫向滑動之定位凸片部件」。

－客觀上最合理寬廣解釋請求項範圍：

原告雖主張：依據系爭專利之申請歷史檔案之美國及大陸地區對應案及相關案件內容，系爭專利之橫向滑動(laterally slidingly)係二個副詞，均是用於修飾動詞迫使(urge)，以形容斜角邊緣部(diagonal edge portion)，迫使光罩與光罩限制器嚙合之具體方式，系爭專利請求項「橫向滑動迫使」應解釋為「橫向且相對滑動地迫使，即光罩與複數個光罩限制器在適當嚙合」云云。惟依系爭專利請求項1、6、12及說明書及圖式之整體內容可知，系爭專利請求項第1、6、12項「橫向滑動」以達到基部定位者係「光罩」，橫向滑動之主體係「光罩」。準此，原告主張為片面解讀，自非客觀上最合理寬廣範圍。

—原告錯誤讀入說明書或圖式內容：

原告固主張：依據系爭專利及其對應案之審查歷程，系爭專利請求項「光罩定位凸片」，應解釋為「由可橫向地相對滑動方式迫使光罩移動之斜角邊緣部及可限制光罩移動之垂直邊緣部構成之部件」云云。然參諸系爭專利請求項6界定「當蓋部與基部配合時，光罩定位凸片適用於橫向滑動迫使光罩與光罩限制器嚙合」；請求項12界定「當蓋部與基部配合時，橫向滑動定位光罩使其與光罩限制器嚙合之自內表面突出之光罩定位凸片」。可知系爭專利請求項未界定「光罩定位凸片，係由斜角邊緣部及垂直邊緣部構成之部件」。職是，原告主張係不當錯誤讀入說明書或圖式內容，且限縮系爭專利請求項文字所界定之客觀上最合理寬廣之範圍，不足為憑。

六、舉發證據不足以證明系爭專利請求項1、3、4、6、7、9、10、12、13、17不具新穎性與進步性：

(一)系爭專利請求項1與證據2相較：

1.證據2之揭露部分：

證據2圖1至3揭示：一可放置光罩(10)而具有上蓋(1)，相當於系爭專利之蓋部之光罩，下蓋(2)相當於系爭專利之基部之光罩盒。揭露系爭專利「一種光罩載具，用於承載光微影半導體製程中所使用之光罩，光罩通常係平面者，具有相對之上表面及下表面及四個隅角」、「一蓋部，用於緊密配合該基部」技術特徵。參諸證據2第90頁右下區塊第2行以下相關文字說明，證據2圖2揭示：光罩收納於盒裡，在左右側及前側（光罩取出方向）設有抵持件(11)，以防止光罩在凸柱(8)上移動。證據2第92頁右上區塊倒數第3行以下圖式簡單

說明記載：第2圖是光罩收納於盒裡後，對其抵持以防止前向及橫向滑動之狀態。證據2「左右側及前側設有抵持件」揭露系爭專利「複數個相間隔之光罩限制器」技術特徵。

2.證據2未揭露部分：

－證據2雖揭示：設有抵持件(11)，防止光罩(10)在凸柱(8)上移動；對其抵持以防止前向及橫向滑動之狀態。然證據2未揭露系爭專利「當蓋部與基部配合時，光罩定位凸片可迫使光罩橫向滑動與光罩限制器嚙合」技術特徵，更遑論揭露系爭專利請求項1「光罩定位凸片具有一斜角邊緣部，當蓋部與基部配合時，斜角邊緣部之方向，係可橫向滑動迫使光罩與光罩限制器嚙合，光罩定位凸片係被定位成與光罩之光罩中間相鄰隅角嚙合」技術特徵。

—原告固主張：證據2「壓腳(11)彎曲弧線」及「彎曲弧線結構之設置位置」引導、定位光罩之功能，係客觀上固有存在，並發揮與系爭專利相同之固有功能云云。惟證據2圖2與證據2第90頁右下區塊第2行以下相關文字說明揭示「光罩(10)收納於盒裡，在左右側及前側(光罩取出方向)設有抵持件(11)，以防止光罩在凸柱(8)上移動」。是證據2之抵持件雖具有限制光罩移動之功能，然證據2圖2之抵持件並未與光罩接觸，無法據以認定證據2圖2揭示抵持件可接觸光罩之隅角，並迫使光罩橫向滑動進而推動光罩至正確位置，本領域具通常知識之人，由證據2之內容並無法無歧異得知「證據2之上蓋配合下蓋時，尚未密合時，抵持件接觸光罩之隅角，並橫向滑動迫使光罩進而推動光罩至正確位置」技術內容，更無法認定證據2「抵持件之不明顯之彎曲弧線」及「彎曲弧線結構之設置位置」，具有引導、定位光罩之功能係客觀上

固有存在，原告主張不足為憑。

．原告雖主張：證據2所揭示之抵持件(11)具有「斜緣推送部」及「頂端角落抵持部」，當證據2之上蓋配合下蓋時，尚未密合時，「斜緣推送部」可接觸光罩之隅角，並橫向滑動迫使光罩進而推動光罩至正確位置；而當上蓋配合下蓋已完全密合時，與光罩接觸者乃「頂端角落抵持部」，而「頂端角落抵持部」具有固持並限制光罩移動之功能，故係用於光罩在遭「斜緣推送部」迫使後係與「頂端角落抵持部」嚙合云云。然證據2圖2與證據2第90頁右下區塊第2行以下相關文字說明揭示：光罩(10)收納於盒裡，在左右側及前側（光罩取出方向）設有抵持件，以防止光罩在凸柱(8)上移動」，是證據2之抵持件具有限制光罩移動之功能。至原告108年9月5日行政訴訟起訴狀第18頁所記載之證據2圖2「斜緣推送部」及「頂端角落抵持部」文字及紅色、藍色線條註記，並非為證據2說明書所揭示之內容，自不得據以認定該圖2上之註記內容，為本領域具通常知識之人均能無歧異得知。且證據2圖2之抵持件並未與光罩接觸，無法據以認定證據2圖2已揭示抵持件可接觸光罩之隅角，並迫使光罩橫向滑動進而推動光罩至正確位置，本領域具通常知識之人，由證據2之內容，並無法無歧異得知「證據2之上蓋配合下蓋時，尚未密合時，斜緣推送部可接觸光罩之隅角並橫向滑動迫使光罩進而推動光罩至正確位置」技術內容，原告主張不足為憑。

(二)系爭專利請求項1與證據3相較：

1.證據3之揭露部分：

證據3圖1揭示：一種光罩載具(100)，可承載光罩(105)，具有門(104)，相當於系爭專利之基部；相間隔的光罩支架(11

2)；一殼體，相當於系爭專利之蓋部；用於緊密配合門(104)及2個相間隔光罩保持器(114)，相當於系爭專利之光罩限制器。揭露系爭專利請求項1「一種光罩載具，用於承載光微影半導體製程中所使用之光罩，光罩通常係平面者，具有相對之上表面及下表面及四個隅角，載具包括：一基部，具有至少一對相間隔的光罩支架」、「一蓋部，用於緊密配合基部，蓋部具有一內表面，其上突設有複數個相間隔之光罩限制器」技術特徵。

2.證據3未揭露部分：

－系爭專利請求項1與證據3之差異，在於證據3未揭露系爭專利請求項1「光罩支架被定位且適於接觸及支撐光罩之下表面，光罩係可在其上橫向滑動」技術特徵，證據3未揭露系爭專利「當蓋部與基部配合時，光罩定位凸片可迫使光罩橫向滑動與光罩限制器嚙合」技術特徵，更遑論揭露前述證據2所未揭露之系爭專利請求項1之技術特徵。

—原告雖主張：證據3說明書第0024段指出「在一較佳實施例中，4個支架(112)沿光罩角落的下邊緣倒角支撐光罩。可理解可採用其他支撐結構接觸及支撐光罩。例如，除沿光罩角落外，光罩支架可沿光罩邊緣接觸支撐光罩，或沿角落及邊緣接觸支撐光罩，或/且可接觸於光罩之下表面」。證據3揭露「光罩係可在光罩支架上橫向滑動」技術特徵云云。惟證據3說明書第0024段揭示：一倒角係通常被提供圍繞光罩(105)一下邊緣，在一較佳的實施中，四個支架112（在門104上）沿著光罩角隅處之下邊緣倒角支撐光罩。且揭示「光罩支架可以在以下位置接觸光罩；沿著其相對之邊緣，或是進一步於其角隅處；光罩支架亦可同時或僅接觸光罩之下表面

」。因圍繞光罩之下邊緣設有倒角，光罩支架係沿著下邊緣之倒角支撐光罩，光罩之橫向移動將會被光罩支架所限制。職是，證據3未揭露系爭專利「光罩支架被定位且適於接觸及支撐光罩之下表面，光罩係可在其上橫向滑動」技術特徵，原告主張不足為憑。

(三)系爭專利請求項1與證據3-1相較：

由證據3-1圖3、11揭示「光罩保持器(114)斜面凹槽(148)及光罩支架(112)上之柱(126)所設斜面凹槽(128)」結構可知，斜面凹槽適於使光罩下落至定位，並可用以限制光罩(127)橫向移動，斜面凹槽及斜面凹槽之結構並不適於讓光罩橫向滑動。證據3-1未揭露證據2所未揭露之系爭專利請求項1之技術特徵。至原告雖主張：證據3-1說明書第9欄倒數第3行至第10欄第7行「各光罩保持器(114)包括一懸桁部分，設於光罩保持器基座(136)末端。各懸桁部分之末端包括斜壁凹槽，倒置相對於光罩支架之各支柱上之斜壁凹槽，斜壁凹槽包括一對側壁(149、150)，自其頂部至底部向外傾斜，且於水平面上互相形成直角」；第11欄第4至6行「可藉由懸桁部分施力，和緩地的將光罩推動至其正確的唯一結果位置上」。證據3-1揭露系爭專利之C群組「光罩定位凸片可橫向滑動迫使光罩與光罩限制器嚙合」特徵云云。惟證據3-1說明書第11欄第4至6行係「可藉由懸桁部分施力，和緩將光罩推動至其正確之唯一結果位置上」，證據3-1圖3、11揭示「光罩保持器之斜面凹槽及光罩支架上之柱所設斜面凹槽128」結構可知，斜面凹槽適於使光罩下落至定位，並可用以限制光罩橫向移動，斜面凹槽及斜面凹槽之結構並不適於使光罩橫向滑動，證據3-1未揭露系爭專利之C群組「光罩定位凸片

可橫向滑動迫使光罩與光罩限制器嚙合」特徵，原告主張不足為憑。

(四)系爭專利請求項1與證據4相較：

證據4摘揭示「本發明提供一種可矯正連接器等電子零件之位置之電子零件之位置矯正方法及位置矯正用治具」、「前述位置矯正用治具(15)具有：支撐構件(12)、位置矯正用板(11)、位置矯正具(13、14)，藉由支撐構件支撐基板(1)後安裝位置矯正用板，並將位置矯正具插入位置矯正用板之位置矯正用孔(11i、llj)，藉由位置矯正具14之相對面(14a、14b)及位置矯正具(13)傾斜面(13a)進行位置矯正」。可知證據4之發明與光罩載具技術無關，證據4未揭露任何對光罩收納之蓋部與基部之技術內容，更遑論揭露前述證據2所未揭露之系爭專利請求項1之技術特徵。

(五)系爭專利請求項1與證據5相較：

證據5摘要揭示「一種可輕易進行在光罩上張貼護件之工序之護件盒」、「本發明之護件盒具備：保持板(3)，其包含：放置面(3C、3D)，其供作為護件構成要素之框架(1)用於張設薄膜(2)側之端面(1C、1D)放置其上；抵接部(3A)，其抵接於框架外周面(1A)而將框架定位；可裝卸之蓋(6)，其將護件收納於其與保持板間」。可知證據5之發明並非光罩載具，且由證據5說明書第0004段及圖5揭示之上蓋(106)之傾斜面(106a)，其抵接於護件框(101)隅角，將護件框夾於上蓋與底座間。可知證據5未揭示光罩支架之結構，證據5之傾斜面係用以夾持護件框，證據5之傾斜面並不相當於系爭專利「光罩定位凸片」。職是，證據5未揭露證據2所未揭露之系爭專利請求項1之技術特徵。

(六)系爭專利請求項1與原證7相較：

1.原證7之揭露部分：

原證7圖1至3揭示「一可放置光罩(10)而具有上蓋(1)相當於系爭專利之蓋部之光罩盒，下蓋(2)相當於系爭專利之基部之光罩盒」，揭露系爭專利「一種光罩載具，用於承載光微影半導體製程中所使用的光罩，光罩通常係平面者，具有相對之上表面及下表面及四個隅角」、「一蓋部，用於緊密配合基部」技術特徵；原證7圖2與原證7-1第77頁相關文字說明揭示「光罩收納於盒裡，在左右側及前側設有壓腳(11)，以防止光罩在銷(8)上移動」，原證7「左右側及前側設有壓腳」揭露系爭專利「複數個相間隔之光罩限制器」技術特徵。

2.原證7未揭露部分：

原證7未揭露系爭專利「當蓋部與該基部配合時，光罩定位凸片可迫使光罩橫向滑動與該光罩限制器嚙合」技術特徵，是原證7未揭露前述證據2所未揭露之系爭專利請求項1之技術特徵。

(七)原告於109年1月14日庭期提出盒子不具證據能力：

原告雖於109年1月14日之庭期當庭提呈一盒子，主張係其自行模擬證據2之實物，主張該實物無異於證據2之實施例，藉以輔助說明證據2揭露之技術內容云云。惟該實物之與證據2揭示之內容並非完全一致，如證據2圖3中僅局部顯示角(13)位於靠近元件(14)處，且僅有1個角之斷面圖，且該角僅可看出有一個朝上之爪。而該實物具有2個斷面類似角之物，且2個類似角之物，各具有兩個朝上之爪。且證據2之專利說明書已例示說明其實施方式，是以藉由該實物輔助說明證據

2揭露之技術內容，核無必要性。且該實物之完成公開日期顯屬不明，無法認定其公開日係早於系爭專利之優先權日，該實物非為適格之先前技術，不具證據能力，原告主張不足為憑。

(八)原告對證據24及證據25之解讀有誤會：

1.原證24部分：

原告雖主張：由原證24及原證25內容可知，設計光罩載具之人當然應具備機械設計之基本知識。而最基礎之機械設計之通常知識，可由關於凸輪之知識，依參加人所宣稱，該領域之通常知識為無論「斜角」、「凸輪面」、「斜面」，均能自其設計曲面導引物件並定其移動路線，以達到迫使光罩橫向移動之功能云云。然原證24為參加人關於本院104年度行專訴字第96號之行政參加言詞辯論補充意旨狀，參加人於原證4第10至11頁陳明「設計光罩載具之人當然應具備機械設計之基本知識，而最基礎之機械設計之通常知識，可由關於凸輪之知識可見一斑，凸輪(cam)是機械領域一門古老而實用之技術，且為機械工程所必須修習之科目之一」、「設計光罩載具之技藝人士所具備之技術水準或通常知識，在其得知系爭專利係利用蓋部之光罩定位凸片，隨蓋部移動而推動光罩至定位之技術思想後，不可能僅能瞭解並實施系爭專利實施例之內容，而是能依據其專業知識設計出各種符合推動光罩橫向移動至定位之需求之光罩定位凸片形狀或結構。

2.原證25部分：

原證25為參加人關於他案107年度行專更(一)字第1號言詞辯論筆錄，參加人於原證25中陳明：系爭專利之主要特徵，其實是利用一個從蓋部內表面延伸而出之一個凸片形狀，達成

在光罩初期於基部定位不精確時，可以將光罩橫向滑動推動到一個相對精確的位置，以達成與蓋部之光罩限制器嚙合效果，因此只要是從內表面延伸的凸片，而能夠達成此功能者之形狀，認為均在請求項6之光罩定位凸片範圍。

3.前案揭露有關斜面未等同光罩定位凸片：

參諸原證24及原證25內容可知，參加人係於他案陳明設計光罩載具之人當然應具備機械設計之凸輪之基本知識，系爭專利所屬技術領域中具有通常知識者，可依系爭專利之說明書及圖式而將光罩定位凸片，設計成各種符合推動光罩橫向移動至定位之需求之光罩定位凸片形狀或結構，參加人未主張或承認所有前案揭露有關「斜面」，用以支撐或接觸光罩之物可等同於系爭專利之可迫使光罩橫向移動光罩定位凸片。原告對證據24及證據25之解讀應有誤會，原告主張尚不可採。

(九)舉發證據不足證明系爭專利請求項不具新穎性與進步性：

1.舉發證據不足系爭專利請求項1不具新穎性與進步性：

－證據2、證據3、證據3-1、證據4、證據5及原證7未揭露系爭專利請求項1「光罩定位凸片具有一斜角邊緣部，當蓋部與基部配合時，斜角邊緣部之方向，可橫向滑動迫使光罩與光罩限制器嚙合，光罩定位凸片係被定位成與該光罩之光罩中間相鄰隅角嚙合」技術特徵，是以證據2併同其補強證據：證據3、證據3-1、證據4、證據5、原證7，不足以證明系爭專利請求項1不具新穎性。

—參加人未主張或承認所有前案揭露有關「斜面」用以支撐或接觸光罩之物可等同於系爭專利之可迫使光罩橫向移動光罩定位凸片，且證據2、證據3、證據3-1、證據4、證據5、原

證7未揭露系爭專利「當蓋部與基部配合時，光罩定位凸片可迫使光罩橫向滑動與光罩限制器嚙合」技術特徵。職是，系爭專利請求項1非為所屬技術領域中，具有包括關於凸輪機械設計之基本知識之通常知識者依證據2，併同其補強證據之證據3、證據3-1、證據4、證據5、原證7等先前技術，藉由簡單之轉用、置換、修飾等手段所能輕易完成，故證據2併同其補強證據之證據3、證據3-1、證據4、證據5、原證7，不足以證明系爭專利請求項1不具進步性。

2.舉發證據不足證系爭專利請求項3與4不具新穎性與進步性：系爭專利請求項3、4依附請求項1，包含請求項1之全部技術特徵，證據2併同其補強證據之證據3、證據3-1、證據4、證據5、原證7，不足以證明系爭專利請求項1不具新穎性、進步性，業如前述。是證據2併同其補強證據之證據3、證據3-1、證據4、證據5、原證7，不足以證明系爭專利請求項3與4不具新穎性及進步性。

3.舉發證據不足證明系爭專利請求項6不具新穎性與進步性：證據2、證據3、證據3-1、證據4、證據5、原證7未揭露系爭專利「當蓋部與基部配合時，光罩定位凸片可迫使光罩橫向滑動與光罩限制器嚙合」技術特徵。是證據2併同其補強證據之證據3、證據3-1、證據4、證據5、原證7，未揭露系爭專利請求項6所界定「至少一自內表面突出之光罩定位凸片，當蓋部與基部配合時，光罩定位凸片適用於橫向滑動迫使光罩與光罩限制器嚙合」技術特徵。故證據2併同其補強證據之證據3、證據3-1、證據4、證據5、原證7，不足以證明系爭專利請求項6不具新穎性。系爭專利請求項6非為所屬技術領域中具有通常知識者依證據2，併同其補強證據之證據3

、證據3-1、證據4、證據5、原證7等先前技術，藉由簡單之轉用、置換、修飾等手段所能輕易完成，證據2併同其補強證據之證據3、證據3-1、證據4、證據5、原證7，不足以證明系爭專利請求項6不具進步性。

4.舉發證據不足證明系爭專利請求項7、9及10不具新穎性與進步性：

系爭專利請求項7、9、10依附請求項6，包含請求項6之全部技術特徵，證據2併同其補強證據之證據3、證據3-1、證據4、證據5、原證7，不足以證明系爭專利請求項6不具新穎性、進步性。職是，證據2併同其補強證據之證據3、證據3-1、證據4、證據5、原證7，不足以證明系爭專利請求項7、9及10不具新穎性與進步性。

5.舉發證據不足證明系爭專利請求項12不具新穎性與進步性：

證據2、證據3、證據3-1、證據4、證據5、原證7未揭露系爭專利「當蓋部與基部配合時，光罩定位凸片可迫使光罩橫向滑動與光罩限制器嚙合」技術特徵。是證據2併同其補強證據之證據3、證據3-1、證據4、證據5、原證7，未揭露系爭專利請求項12所界定「用於當蓋部與基部配合時，橫向滑動定位光罩使其與光罩限制器嚙合之自內表面突出之光罩定位凸片」技術特徵。證據2併同其補強證據之證據3、證據3-1、證據4、證據5、原證7，不足以證明系爭專利請求項6不具新穎性。系爭專利請求項12非為所屬技術領域中具有通常知識者，依證據2併同其補強證據之證據3、證據3-1、證據4、證據5、原證7等先前技術，藉由簡單的轉用、置換、修飾等手段所能輕易完成，證據2併同其補強證據之證據3、證據3-1、證據4、證據5、原證7，不足以證明系爭專利請求項12

不具進步性。

6.舉發證據不足證明系爭專利請求項13與17不具新穎性與進步性：

系爭專利請求項13、17依附請求項12，包含請求項12之全部技術特徵，證據2併同其補強證據之證據3、證據3-1、證據4、證據5、原證7，不足以證明系爭專利請求項12不具新穎性、進步性。是證據2併同其補強證據之證據3、證據3-1、證據4、證據5、原證7，不足以證明系爭專利請求項13與17不具新穎性、進步性。

七、本判決結論：

綜上所述，證據2、證據3、證據3-1、證據4、證據5、原證7，不足以證明系爭專利請求項1、3、4、6、7、9、10、12、13、17不具新穎性、進步性。被告認系爭專利未違反審定時專利法第22條第1項第1款、第4項規定，被告所為請求項1、3至4、6至7、9至10、12至13、17舉發不成立之行政處分，其於法有據，訴願決定予以維持，亦無違誤。職是，原告仍執前詞訴請撤銷不利於己之原處分與訴願決定，為無理由，應予駁回。

八、無庸審究部分說明：

原告雖於109年1月14日，當庭以書狀聲請傳喚具日本留學經歷之機械系教授，到庭釐清證據2揭露技術內容（見本院卷一第322至324頁）。然證據2為專利公開案件，其說明書及圖式已清楚及明確之揭露技術內容，對於所屬技術領域中具有通常知識者應能清楚瞭解其內容，是核無傳喚專家意見之必要。況本院就證據2之技術分析，已論述如前。本件事證已明確，暨兩造其餘攻擊防禦方法，均與本件判決結果不生

影響，爰不逐一論述，併此敘明。

據上論結，本件原告之訴為無理由，爰依智慧財產案件審理法第1條、行政訴訟法第98條第1項前段，判決如主文。

中　　華　　民　　國　　109　　年　　7　　月　　9　　日

智慧財產法院第二庭

審判長法　官　汪漢烽

法　官　彭洪英

法　官　林洲富

以上正本係照原本作成。

如不服本判決，應於送達後20日內，向本院提出上訴狀並表明上訴理由，其未表明上訴理由者，應於提起上訴後20日內向本院補提上訴理由書；如於本判決宣示後送達前提起上訴者，應於判決送達後20日內補提上訴理由書（均須按他造人數附繕本）。

上訴時應委任律師為訴訟代理人，並提出委任書（行政訴訟法第241條之1第1項前段），但符合下列情形者，得例外不委任律師為訴訟代理人（同條第1項但書、第2項）。

得不委任律師為訴訟代理人之情形	所　需　要　件
符合右列情形之一者，得不委任律師為訴訟代理人	1.上訴人或其法定代理人具備律師資格或為教育部審定合格之大學或獨立學院公法學教授、副教授者。 2.稅務行政事件，上訴人或其法定代理人具備會計師資格者。 3.專利行政事件，上訴人或其法定代

	理人具備專利師資格或依法得為專利代理人者。
非律師具有右列情形之一，經最高行政法院認為適當者，亦得為上訴審訴訟代理人	1.上訴人之配偶、三親等內之血親、二親等內之姻親具備律師資格者。 2.稅務行政事件，具備會計師資格者。 3.專利行政事件，具備專利師資格或依法得為專利代理人者。 4.上訴人為公法人、中央或地方機關、公法上之非法人團體時，其所屬專任人員辦理法制、法務、訴願業務或與訴訟事件相關業務者。
是否符合　、　之情形，而得為強制律師代理之例外，上訴人應於提起上訴或委任時釋明之，並提出　所示關係之釋明文書影本及委任書。	

中　　華　　民　　國　　109　　年　　7　　月　　9　　日

書記官　蔡文揚